

Readout

HORIBA Technical Reports

October 2018 No. **51**

特集 2018 堀場雅夫賞

- 受賞論文
- ・レーザー干渉計によるプラズマ電子密度計測の高速・高精度化
 - ・高精度半導体プラズマプロセスのための基板温度計測システムの開発
 - ・半導体プラズマプロセス中の薄膜材料の欠陥検出
 - ・イオンの速度分布関数による非侵襲的プラズマ特性解析

**HORIBA**<http://www.horiba.com/jp/publications/readout/>